

УСТРОЙСТВО ПРОГРАММНОГО УПРАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОУЧЕБНОЙ ТЕХНОЛОГИЕЙ

В.Г.Дуженский, В.И.Титова, А.И.Трубецкой

Интенсивные работы на протяжении ряда лет ведутся в области использования электронных пучков в микролитографии, где они применяются для получения диэлектрических и металлических пленок, изготовления масок, макросхемы выводов, создания активных и пассивных элементов, ионного легирования, зачистки электронных регистров и др.

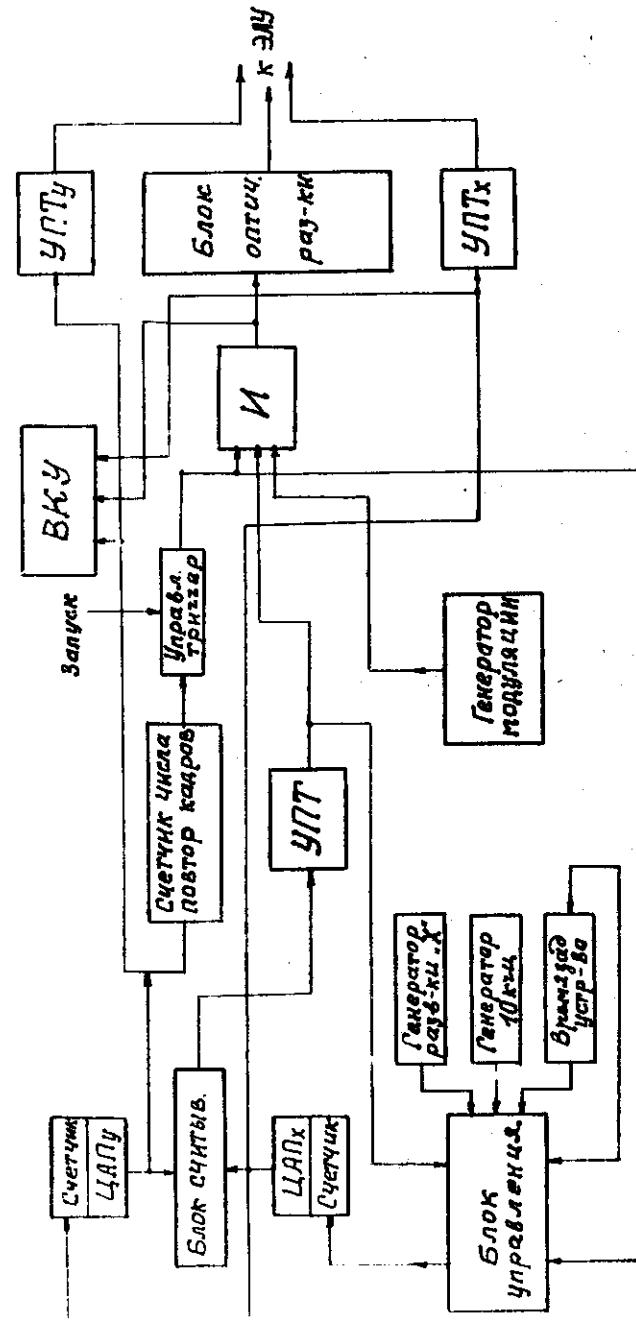
Реализация преимуществ электронно-лучевой технологии невозможна без создания систем программного управления. Для управления положением луча помимо специализированных машин необходима целая система прицельного управления на основе быстрого изучения I-2. Основным недостатком подобных систем управления является шестидневная скорость сканирования кадра и некоторое следствие этого, - потеря времени на обработку полученной информации на фонографии.

Авторами разработано устройство, в котором этот недостаток устранен. Блок-схема устройства изображена на рисунке. С помощью блока управления обеспечивается четыре режима работы:

I. Сканирование фотонегатива с постоянной скоростью, определяемой частотой генератора строчной развертки;

2. Сканирование фотонегатива на двух скоростях развертки: скорость облучения требуемых участков осуществляется от генератора строчной развертки, а скорость прохождения необрабатываемых участков задается максимально возможной (10 кгц);

3. Скорость сканирования рабочих участков осуществляется от генератора строчной развертки, а время прохождения лучом изображаемых участков равно времени, задаваемого с помощью времязадающего устройства, плюс время, затраченное на проходе-



EINSTEINIAN ELECTRODYNAMICS AND THEORETICAL TECHNOLOGY.

иис лучом этих участков со скоростью, определяемой частотой генератора строчной развертки;

4. Время сработки точек (рост столбиков) равно времени, создаваемого времязадающим устройством, а скорость прохождения необрабатываемых участков определяется частотой генератора строчной развертки.

Модулирующие импульсы подаются на модематор электроннолучевой установки (ЭЛУ) с помощью блока оптической связки. В качестве источника света используется световой диод, а приемником служит ФЭУ. Для контроля передаваемого изображения применено видеоконтрольное устройство (ВКУ), выполненное на электроннолучевой трубке с длительным послесвечением.

Макет устройства обеспечивает следующие основные параметры: 1) Разрешение 50 линий на кадр; 2) Регулируемое число повторений кадров от 1 до 99; 3) Частота строк от 50 - 0,01 гц; 4) Частота кадров 0,2 - 0,0004 гц. 5) Длительность импульса модуляции $2 \cdot 10^{-6}$ - 1 сек; длительность паузы между импульсами модуляции $2 \cdot 10^{-6}$ - 1 сек; 6) Выходной ток УПТ ± 200 ма.

Устройство управления предназначено для обработки технологических процессов получения диэлектрических и металлических пленок из газовой фазы.

Л и т е р а т у р а

1. ОСТРОВЕРХОВ Н.Т., ПОЛОВ В.К. Автоматизация процесса обработки деталей электронным пучком. - Электронная обработка материалов, 1969, № 6.

2. Matsui J., Tanaka K., Kanaya. Electron beam micro machining and recording by using flying spot control system. Bulletin of the Electro Mechanical Laboratory, 1969, N 11.